Реєстраційна картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0119U100730

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 17-02-2019

II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження ()

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201040

У тому числі по роках:	
2019	480.000 тис. грн.
2020	480.000 тис. грн.
2021	480.000 тис. грн.
Загальний обсяг фінансування: 1440.000 тис. грн.	

III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 38621185

Місцезнаходження: проспект Перемоги, буд. 10, м. Київ, 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380444813221

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240

Місцезнаходження: вул. Коцюбинського, буд. 2, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58012, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380372584810, 380372552914

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Високоякісні поверхнево-бар'єрні структури на основі тонких плівок нітридів металів для електроніки та фотовольтаїки

Назва роботи англійською:

High-quality surface-barrier structures based on metal nitrides thin films for electronics and photovoltaics

Мета роботи українською:

Метою проекту є: одержання високоякісних поверхнево-бар'єрних структур шляхом нанесення тонких плівок нітридів металів, зокрема TiN, MoN, CrN, AlN, Zn3N2, W2N, Fe4N, Sn3N4 на напівпровідникові кристали та тонкі плівки з плоскою та наноструктурованою поверхнею з заданими і відтворюваними електричними і фотоелектричними властивостями; встановлення закономірностей протікання фізичних процесів у створених фоточутливих структурах у залежності від конструкційних особливостей і технологічних процесів, а також розробка нових та покращення існуючих методів аналізу електричних і фотоелектричних властивостей поверхнево-бар'єрних структур, покращення їх параметрів

Мета роботи англійською:

The purpose of the project is to obtain high-quality surface-barrier structures by depositing thin films of metal nitrides (TiN, MoN, CrN, AlN, Zn3N2, W2N, Fe4N, Sn3N4) on semiconductor crystals and thin films with flat and nanostructured surface with predetermined and reproducible electrical and photovoltaic properties; the establishment of regularities flowing of physical processes in the created photosensitive structures depending on the structural features and technological processes, as well as developing new and improving existing ones methods of analysis of electric and photoelectric properties of surface-barrier structures, improvement of their parameters

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: М 72.19. Дослідження і експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Майструк Едуард Васильович

Науковий ступінь: д. ф.-м. н.

Вчене звання: доц.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Високоякісні поверхнево-бар'єрні структури на основі тонких плівок нітридів металів для електроніки та фотовольтаїки

Початок етапу: 01.2019

Закінчення етапу: 12.2021

Вид звітного документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 669:[621.315.59:544.034.2, 669:[621.315.59:544.35, 621.38.049.77.002; 621.375.82.002

Коди тематичних рубрик: 53.41.47, 53.41.49

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Саміла Андрій Петрович

д. т. н., 05.12.13

Відповідальний за підготовку облікових документів Холодницька Любов Миколаївна

Телефон +38 (037) 258-48-18

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності Юрченко Т.А.